

PECVD 系统 OTF-1200X-II-80-4CLV-PE (带滑轨)

技术规格书



OTF-1200X-II-80-4CLV-PE (带滑轨) 是一款滑动式双温区 PECVD 管式炉系统。该系统包含等离子射频电源, 双温区滑轨炉, 4 通道质量流量供气系统和机械泵机组, 可用于生长纳米或石墨烯材料。

技术参数:

设备名称型号	PECVD 系统 OTF-1200X-II-80-4CLV-PE (带滑轨)
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 射频电源可实现等离子增强从而显著降低实验温度 • 滑轨炉可使样品快速加热和快速冷却 • 加热炉含有两个温区, 温度梯度最大可达 200℃ • 可制备碳、氧化锌纳米管或纳米线及单层石墨烯等
滑轨炉参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源: AC220V/50HZ • 功率: 3.0KW • 加热区长度: 200mm*2 • 最高温度: 1200 度 (≤30min) • 工作温度: 1100 度 • 热电偶: K 型 • 智能化仪表, PID 控制, 30 段程序控温 • 炉体可滑动位移: 600mm • 炉管尺寸: $\phi 80*1400$mm
法兰	<ul style="list-style-type: none"> • 标配一套不锈钢真空法兰 • 进气端法兰上安装了一个机械压力表用于观察炉管内的压力, 压力表范围-0.1-0.15MPa; 一个 $\phi 6.35$ 的卡套接头作为进气口使用, 并通过一个不锈钢针阀控制进气的通断 • 出气端法兰包含一个 $\phi 8$mm 宝塔气嘴的出气口, 并通过一个不锈钢针阀控制出气的通断。一个 KF25 接口为抽真空接口, 用于连接真空系统。一个 KF16 的接口用于连接电阻真空计。

	 
<p>真空系统</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：AC220V/50Hz • 功率：0.55KW • 极限真空度：5.0*10⁻¹Pa（无负载） • 抽气速率：3L/s • 抽气口：KF25 接口 • 可选配真空度更高的系统
<p>供气系统</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 型号：GSL-4Z-LCD • 质量流量控制器：100SCCM、200SCCM、200SCCM、500SCCM • 量程可以选配 • 精度：±1.5%FS • 最大压力：0.3MPa • 内部连接 1/4 英寸不锈钢和聚四氟管 • 内置不锈钢混气罐
<p>射频电源</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 功率输出范围：0-500W • 功率稳定度：≤±5W • 射频频率：13.56MHZ • 自动匹配 • 噪音：≤50dB • 冷却方式：风冷
<p>设备外形尺寸</p>	<p>约 2300 长*700 宽*1380mm 高</p> 
<p>设备重量</p>	<p>约 240KG</p>
<p>质保</p>	<p>一年质保期，终生维护</p> <ul style="list-style-type: none"> • 特别提示： 1、耗材部分如加热元件、炉管、样品坩埚等不包含在内 2、因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内
	<ul style="list-style-type: none"> • 石英管内的气压不可高于 0.02MPa； • 气瓶上必须安装减压阀，为了确保安全，建议使用压力低于 0.02MPa，建议在本公司选购减压阀，本公司减压阀量程为 0.01MPa-0.1MPa，使用时会更加精确安全；

使用注意事项

- 对于样品加热的实验，不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热，则需时刻关注压力表的示数，若气压表示数大于 0.02MPa，必须立刻打开出气阀，以防意外发生（如炉管破裂，法兰飞出等）
- 我们不建议客户使用易燃易爆和有毒的气体，如果客户工艺原因确实需要使用易燃易爆和有毒气体，请客户自行做好相关防护和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒气体而造成的相关问题，本公司概不负责。

合肥科晶